

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成30年9月6日(2018.9.6)

【公表番号】特表2017-538102(P2017-538102A)

【公表日】平成29年12月21日(2017.12.21)

【年通号数】公開・登録公報2017-049

【出願番号】特願2017-518136(P2017-518136)

【国際特許分類】

G 01 B 11/00 (2006.01)

G 01 N 21/88 (2006.01)

H 01 L 21/66 (2006.01)

【F I】

G 01 B 11/00 G

G 01 N 21/88 Z

H 01 L 21/66 J

【手続補正書】

【提出日】平成30年7月26日(2018.7.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項2】

前記干渉計装置(30)が光導波路を備える集積光学装置であり、前記光導波路の入力部が前記光源に結合され、前記光導波路が2つの分岐に分割され、前記光導波路の出力部が、前記2つのビームの交差点に前記測定体積を形成するために方向付けられる、請求項1に記載の方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0071

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0071】

別の実施形態によれば、図3Aおよび図6Aに示すように、測定体積は、ウェハ2の主表面Sの垂線に対して角度θで傾けられる。